

Modalités de contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances et des compétences

Compléter le tableau pour le semestre : une ligne par épreuve d'ECUE (ou par épreuve d'UE pour les UE sans ECUE). Cf. onglet "Consignes"

ient aux étudiants bénéficiant d'un régime spécial d'étude (RSE), à l'exception de celles définies pour les UE et ECUE spécifiées dans la décision de la composante annexée au contrat pédagogique. **à forme du contrôle de l'épreuve (colonnes M et T)**, cela signifie que l'épreuve est prévue en présentiel ("P") et qu'en cas de contexte sanitaire ne permettant pas son organisation sur site, les éléments pédagogiques dont l'épreuve est indiquée "P ou D", **les étudiants seront avertis au moins 15 jours avant le début des épreuves de la modalité qui sera appliquée entre "P"**

Numéro de semestre (numéroté de S1 à S10, sinon "aucun") :

S7 et S8

Année :

2023-2024

Diplôme :

MASTER

Domaine (le cas échéant) :

Ingénierie des systèmes complexes

Mention :

Parcours type :

NON

Compensation entre semestre pour valider l'année (oui/non) :

code élément	lib long	libellé en anglais	responsable	nature	crédits	CNU	CM	TD	TP	Session 1					session 2 O/N	Session 2					Nombre de Contrôles Continus					
										C. Term			C. Cont			E. Comp		Durée	C. Term			C. Cont		E. Comp		
										Durée	Infos	%	%	Durée		infos	Durée		Infos	%		%	durée	infos		
VT57IM	Semester 1 Master EIPHI Smart Integrated Systems			SEM	30																					
VT58IM	Semester 2 Master EIPHI Smart Integrated Systems			SEM	30																					
VT70IMI	Parcours Master MIR CMI S1			PAR	30																					
VT70IM	Parcours Master MIR S1			PAR	30																					
VT81IM	Parcours Master MIR S2			PAR	30																					
VT80IMI	Parcours Master MIR CMI S2			PAR	30																					
VT7IMLA	Anglais			UT	3	TAN		18					0%	100%		oral/écrit	N							>1		
VT7DC	Digital control		Redwan DAHMOUCHE	UE	6	61	21	16	20				0%	100%		oral/écrit	O			65%	35%		oral/écrit	>1		
VT7ELNNU	Electronique Numérique		Sébastien EUPHRASIE	UE	6	63	14	11	40				0%	100%		oral/écrit	O			100%	0%		oral/écrit	>1		
VT7INSTR	Instrumentation		Franck CHOLLET	UE	3	63	12	8	12				0%	100%		oral/écrit	N							>1		
VT7IMW2	Mécatronique et Réseaux	Mechatronic systems & networks		UE	6																			>1		
VT7YMSM	Modélisation de systèmes mécatroniques	Mechatronic systems modeling	Hector RAMIREZ ESTAY	ELC	4	61	16	10	12					100%		oral/écrit	O			70%	30%		oral/écrit	>1		
VT7YRLI1	Réseaux Locaux Industriels 1	industrial networks 1	Soukalo DEMBELE	ELC	1	61	1	2	8				0%	100%		oral/écrit	O			60%	40%		oral/écrit	>1		
VT7YRLI2	Réseaux locaux industriels 2	industrial networks 2	Soukalo DEMBELE	ELC	1	61	5	4					0%	100%		oral/écrit	N							>1		
VT7MMTR	Micromécatronique	Micromechatronics	Cédric CLEVY	UE	3	61	13,5	6	9				0%	100%		oral/écrit	O			65%	35%		oral/écrit	>1		
VT7MTECH	Microtechnologie	Microtechnology	Franck CHOLLET	UE	3	63	13	8	8				0%	100%		oral/écrit	O			100%	0%		oral/écrit	>1		
VT7YCAPT	Capteurs actionneurs	Sensors & actuators		ELC	4	61	8	4	26				0%	100%		oral/écrit	N							>1		
VT8CSM	Commande des systèmes multivariables	linear multivariable control	Dominique GENDREAU	UE	6	61	27	15	16				0%	100%		oral/écrit	O			70%	30%		oral/écrit	>1		
VT8ININD	Informatique Industrielle	Industrial computing	Soukalo DEMBELE	UE	3	61	12	4,5	12				0%	100%		oral/écrit	O			60%	40%		oral/écrit	>1		
VT8INFTR	Infotronique	infotronics	Sébastien EUPHRASIE	UE	6	63	8	8	40				0%	100%		oral/écrit	O			100%	0%		oral/écrit	>1		
VT8MTD	Microtransducteurs	Microtransducers	Ausrine BARTASYTE	UE	3	63	12,5	8	8				0%	100%		oral/écrit	O			70%	30%		oral/écrit	>1		
VT8AROU	Outils méthodologiques	Methodological tools	Dominique GENDREAU	UE	3	61							0%	100%		oral/écrit	N							>1		
VT8IMW1	Projet	Project		UE	3																			>1		
VT8YMBIB	Outils recherche bibliographique			ELC	1								0%	100%		oral/écrit	N							>1		
VT8YMPJ	Projet	Project		ELC	2								0%	100%		oral/écrit	N							>1		
VT8IMPJ1	Projet			PRJ	3								0%	100%		oral/écrit	N							>1		
VT8IMW2	Robotique	Robotics	Abdenbi MOHAND OUSAID	UE	6	61	10	9	32				0%				O			50%	50%		oral/écrit	>1		
																								>1		
VT8DP6	OSEC_DP8			UE	3									100%		oral/écrit								>1		
VT8IMK1	Choix			GU	3																					
VT8IMZ1	Profil non CMI			GU	6																					
VT8IMZ2	Profil CMI			GU	6																					

Modalités de contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances et des compétences

Compléter le tableau pour le semestre : une ligne par épreuve d'ECUE (ou par épreuve d'UE pour les UE sans ECUE). Cf. onglet "Consignes"

Ces modalités s'appliquent aux étudiants bénéficiant d'un régime spécial d'étude (RSE), à l'exception de celles définies pour les UE et ECUE spécifiées dans la décision de la composante annexée au contrat pédagogique de ces étudiants.
 Lorsqu'il est indiqué "P ou D" pour la forme du contrôle de l'épreuve (colonnes M et T), cela signifie que l'épreuve est prévue en présentiel ("P") et qu'en cas de contexte sanitaire ne permettant pas son organisation sur site, le contrôle sera réalisé à distance ("D").
 Pour les éléments pédagogiques dont l'épreuve est indiquée "P ou D", les étudiants seront avertis au moins 15 jours avant le début des épreuves de la modalité qui sera appliquée entre "P" ou "D".

Numéro de semestre (numéroté de S1 à S10, sinon "aucun") :

Année :

Diplôme :

Domaine (le cas échéant) :

Mention :

Parcours type :

Compensation entre semestre pour valider l'année (oui/non) :

S9 et S10

2023-2024

MASTER

Ingénierie des systèmes complexes

EIPHI Smart Integrated Systems

NON

code élément	lib long	libellé en anglais	responsable	nature	crédits	CNU	CM	TD	TP	Session 1				session 2 O/N	Session 2				Nombre de Contrôles Continus			
										C. Term		C. Cont	E. Comp		C. Term		C. Cont	E. Comp				
										Durée	Infos	%	Durée		infos	Durée	Infos	%		durée	infos	
VT9SIS	Semestre 3 Master EIPHI Smart Integrated Systems	Semester 3 Master in Microsystems embedded Instrumentation Robotics		SEM	30																	
VT0SIS	Semestre 4 Master EIPHI Smart Integrated Systems	Semester 4 Master in Microsystems embedded Instrumentation Robotics		SEM	30																	
VT90IS	Parcours EIPHI Smart Integrated Systems S3			PAR	30																	
VT00IS	Parcours EIPHI Smart Integrated Systems S4			PAR	30																	
VT9CRM	Commande robuste multivariable	Robust Control		UE	3	61	12	4,5	12				100 %		oral/écrit	N						>1
VT9CEW1	Microsystèmes multiphysiques	Multiphysic Microsystems	Thérèse LEBLOIS	UE	6																	>1
VT9YMAC	Microsystèmes acoustiques	Acoustic microsystems	Sarah BENCHABANE	ELC	3	63	14,5	6	8				100 %		oral/écrit	N						>1
VT9YMBI	Microsystèmes biomédicaux	Biomedical microsystems	Thérèse LEBLOIS	ELC	3	63	13,5	11	4				100 %		oral/écrit	N						>1
VT9NLCT	Commande non linéaire	Nonlinear control		UE	3	61	12	7,5	9				100 %		oral/écrit	N						>1
VT9MPSNM	Simulation numérique des microsystèmes	Numerical simulation of microsystems	Mahmoud ADDOUCHE	UE	3	63	5	16	8				100 %		oral/écrit	N						>1
VT9CNUM	Communications Numériques	Digital transmissions	Mahmoud ADDOUCHE	UE	3	63	8,5	4	16				100 %		oral/écrit	N						>1
VT9ELNEM	Electronique Embarquée	Embedded Electronics	Jean-Michel FRIEDT	UE	3	63	10,5	6	12				100 %		oral/écrit	N						>1
VT9INSTA	Instrumentation avancée	Advanced instrumentation	Jean-François MANCEAU	UE	3	63	10,5	6	12				100 %		oral/écrit	N						>1
VT9ISPJ2	Projet	Project	Franck CHOLLET	PRJ	6								100 %		oral/écrit	N						>1
VT9SINST	Systèmes d'instrumentation	Instrumentation systems	Jean-François MANCEAU	UE	3	63	10,5	10	8				100 %		oral/écrit	N						>1
VT9TCM	Technologies couches minces	Thin film technologies	Ausrine BARTASYTE	UE	3	63	12	9	4				100 %		oral/écrit	N						>1
VT9VI2D	Vision par ordinateur en 2D	2D vision	Sounkalo DEMBELE	UE	3	61	10,5	6	12				100 %		oral/écrit	N						>1
VT9VI3D	Vision par ordinateur en 3D	3D vision	Nicolas ANDREFF	UE	3	61	8,5	8	12				100 %		oral/écrit	N						>1
VT9ISK1	Choix profil	Choix		GU	30											N						>1
VT9ISLA	Anglais	English		UE	3			18					100 %		oral/écrit	N						>1
VT9ISW4	Profil microsystems and microtechnologies	Elective		UE	30											N						>1
VT9ISW2	Profil robotics and microrobotics	Elective		UE	30											N						>1
VT9ISW3	profil embedded systems	Elective		UE	30											N						>1
VT0IMW1	Innovation	Innovation	Philippe LUTZ	UE	6																	>1
VT0YAPP	Ateliers Projet Professionnel		Dominique GENDREAU	UT	1	TIP		9					100 %		oral/écrit	N						>1
VT0YINNO	Innovation	Innovation	Philippe LUTZ	ELC	5	61	21	15	9				100 %		oral/écrit	N						>1
VT0INST	Instrumentation RF	RF instrumentation	Enrico RUBIOLA	UE	3	63	12,5	8	8				100 %		oral/écrit	N						>1
VT0IMPJ	Méthodologie projet	Project methodology	Dominique GENDREAU	UE	3	61	12	18					100 %		oral/écrit	N						>1
VT0IMOB	Microrobotics	Microrobotics	Nicolas ANDREFF	UE	6	61	27,5	13,5	16				100 %		oral/écrit	N						>1
VT0IMW2	Stage 2	Internship	Franck CHOLLET	UE	18																	>1
VT0YMEA	Mémoire et exposé en anglais		Franck CHOLLET	ELC	3								100 %		oral/écrit	N						>1
VT0YMSG	stage	Internship	Franck CHOLLET	ELC	15								100 %		oral/écrit	N						>1
VT0SYSEM	Systèmes embarqués	Embedded systems	Jean-Michel FRIEDT	UE	3	63	12,5	8	8				100 %		oral/écrit	N						>1
																N						>1
																						>1
VT0IMK2	Choix	Elective		GU	6																	>1
VT0IMZ1	Bloc			GU	6																	>1
VT0ISK3	Choix profil			GU	30																	>1
VT0ISW2	Profil 1			PRJ	30											N						
VT0ISW3	Profil 2			UE	30											N						
VT9ISW1	Stage 1	Internship		UE	12																	
VT9YRAPP	Travail et rapport	Work and report		ELC	10								100 %		oral/écrit							
VT9YELA	Exposé en anglais	Presentation in english		ELC	2								100 %		oral/écrit							